

**СОДЕРЖАНИЕ**  
**ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ**  
**ТЕХНИКИ**

**Н. С. Иванов.** Помехоустойчивая М-оценка выборок многократных наблюдений

**НАНОМЕТРОЛОГИЯ**

**В. В. Альзоба, В. П. Гавриленко, А. Ю. Кузин, В. Б. Митюхляев, А. В. Раков, П. А. Тодуа, М. Н. Филиппов.** Нелинейность развертки растрового электронного микроскопа

**ЛИНЕЙНЫЕ И УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ**

**В. Л. Минаев, Г. Н. Вишняков.** Интерференционный профилометр для измерения формы поверхности отражающих объектов

**ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ**

**Ю. А. Пластинин, А. В. Родионов, И. Ю. Скрыбышева.** Моделирование оптико-физических явлений в верхних слоях атмосферы

**МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ**

**Е. М. Белозубов, Н. Е. Белозубова, В. А. Васильев.** Метод уменьшения температурной погрешности тонкопленочных емкостных нано- и микроэлектромеханических систем и датчиков на их основе